



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 069 449 B8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**
Hinweis: Bibliographie entspricht dem neuesten Stand

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
INID code(s) 73

(51) Int Cl.:
G02B 21/16 (1968.09)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
01.02.2006 Patentblatt 2006/05

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
30.11.2005 Patentblatt 2005/48

(21) Anmeldenummer: **00111442.0**

(22) Anmeldetag: **27.05.2000**

(54) **Beleuchtungseinrichtung für ein DUV-Mikroskop**

Illumination system for a deep ultraviolet microscope

Système d'illumination d'un microscope pour l'ultraviolet profond

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB

(30) Priorität: **10.07.1999 DE 19931954**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
17.01.2001 Patentblatt 2001/03

(73) Patentinhaber: **Leica Microsystems CMS GmbH**
35578 Wetzlar (DE)

(72) Erfinder:
• **Danner, Lambert**
35584 Wetzlar-Naunheim (DE)
• **Vollrath, Wolfgang**
57299 Burbach (DE)
• **Eisenkrämer, Frank**
35444 Biebertal (DE)

• **Osterfeld, Martin**
35578 Wetzlar (DE)
• **Veith, Michael**
35578 Wetzlar (DE)

(74) Vertreter: **Reichert, Werner Franz**
Leica Microsystems International Holdings
GmbH,
Konzernstelle Patente + Marken,
Postfach 20 20
35578 Wetzlar (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
DE-A- 2 010 540 **US-A- 5 867 329**

• **PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no.**
03, 31. März 1997 (1997-03-31) & JP 08 313728 A
(NIKON CORP), 29. November 1996 (1996-11-29)

EP 1 069 449 B8

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).